

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' for optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. These include wafer-level optics (WLO), optical sensors and projectors, automotive lighting, waveguides for augmented reality headsets, bio-medical devices, meta-lenses and meta-surfaces, and optoelectronics. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs.



HOME > 뉴스 > 보도자료

EV그룹, 광학기기 제조용 다기능 마이크로 및 나노임프린트 솔루션 'EVG®7300' 출시

KIPOST | 승인 2022.01.19 08:55 | 댓글 0



나노임프린트 리소그래피(NIL), 렌즈 몰딩 및 렌즈 스택링(UV 본딩) 등 UV 기반의 여러 공정을 단일 플랫폼에 결합한 EVG의 최첨단 솔루션

KIPOST 대학(원)생 특별 할인

속성증 인증 방법 알아보기



인기기사

- 1 LG디스플레이, 아이피드용 OLED 라인에 AL
- 2 LG디스플레이, M11 전 파키지에 사용된 L&B 기술
- 3 CGST 유럽 TS 착공
- 4 LG디스플레이, 6G OLED 프로젝트 추진
- 5 LG디스플레이, 연구개발 지원에 100억 투자
- 6 삼성디스플레이, A&E에 중점 투자로 추가
- 7 LG디스플레이, 1분기 실적 발표
- 8 LG디스플레이, 12월 LCD 공장 가동률 93%
- 9 BOE 7세대 LCD 선별률 410% 증가 추정
- 10 [Weekly 신기술 및 동향 소식] 로봇 자율주행

MEMS, 나노 기술, 반도체 제조용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 전문업체인 EV그룹(이하 EVG)은 자회사인 SmartNIL® 나노임프린트 및 웨이퍼 레벨 광학 시스템인 EVG®7300을 출시한다고 19일 밝혔다.

EVG의 최신 솔루션인 EVG7300은 나노임프린트 리소그래피(NIL), 렌즈 몰딩 및 렌즈 스택링(UV 본딩) 같은 UV 기반의 여러 프로세스를 단일 플랫폼에 결합한 것이 특징이다. 이 산업용 다기능 시스템은 마이크로 및 나노 패터닝은 물론 기능 레이어 적층 등을 포함하는 광범위한 신규 애플리케이션의 절단 R&D와 생산 공정 모두에 사용될 수 있다.

적층 범위는 웨이퍼 레벨 광학(WLO), 광학 센서와 프로젝터, 차량용 조명, 증강 현실(AR) 헤드셋용 웨이퍼가이드, 바이오 의료 장비, 메타 렌즈와 메타 표면, 광전자 기기 등이 포함된다. 최대 300mm 웨이퍼까지 지원하고 고정밀 얼라인먼트, 향상된 프로세스 제어, 우수한 스프루트 성능을 자랑하는 EVG7300은 다양한 자유도와 높은 정밀도로 나노 및 마이크로 광학 부품과 기기를 대량 생산하고자 하는 사용자의 요구를 충족한다.

EVG7300은 독립된 도구로 사용하거나, 또는 EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션에 하나의 모듈로 통합해 사용할 수 있다. EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션은 사용자의 특정 프로세스 요건에 따라서 세팅과 레지스트 코팅 및 베이킹 같은 전처리 공정이나 후처리 공정을 추가할 수 있다.

또한 EVG7300은 가장 얇은 얼라인먼트 정확도를 제공한다(300nm까지). 이는 향상된 얼라인먼트 스테이지, 고정밀 광학계, 멀티포인트 감 제어, 비접촉식 걸 측정, 멀티포인트 포스 제어 등 다양한 방법의 조합 덕분에 가능해진 것이다. 유연성도 뛰어난 세 가지 공정 모드(렌즈 몰딩, 렌즈 스택링, SmartNIL 나노임프린트)를 지원하고 150mm부터 300mm까지 이르는 웨이퍼 크기를 지원한다. EVG7300은 신속한 스탬프와 웨이퍼 로딩, 고속 얼라인먼트 광학계, 고전력 경화, 소형화된 플랫폼으로 업계에서 새롭게 떠오르는 WLO 제품의 제조 요구를 충족하는 매우 효율적인 플랫폼을 제공한다.